

微型液体气化仪 LVD-F1

技术规格书



LVD-F1 是一款专门针对实验室中 CVD 实验中导入液体的一套系统,其液体流量是通过一数字液体泵来控制,最小流量控制在 0.007ml/min。液体被数字泵导入到混气系统后,被系统里的加热装置加热成蒸汽,然后随导入的气体被带入到炉管中。LVD-F1 能够导出多种液体,比如 ETOH, SnC14, TiC14r, SiHC13, 和 Zn(C2H5)2,还有多种有机物混合。对于研究用 CVD 方法生长纳米线和薄膜 LVD-F1 是一款极佳的研究工具。

技术参数:

가다 선 선 4선 표인 다	他刑与决演队以 LVD P1
设备名称型号	微型气体液化仪 LVD-F1
产品特点	• 由数字液体泵控制液体流量,最大流量为 10m1/min
	• 一次不锈钢罐加热最高温度 500℃
	• 二次加热带加热最高温度为 200℃
	• 用于材料研究中 CVD 方法生长纳米线和薄膜的合适设备
基本参数	• 电源: 208-240VAC, 单相 50/60HZ
/ /	• 功率: 2.2KW
	• 前面板上的一个调速旋钮用于调节液体的流量大小, LED 显示屏上显
	一示进液速度。 注意:显示屏上的数值是数字泵的转速不是流量值,请对照
	换算表换算成流量
液体流量控制系统	进液显示速度与进液量对照表
	进液显示速度(rpm) 进液量(ml/min)
	0 0
	1.2 1
	6.1 5
	12.2 10
	18.3 15
	24.4 20
	50.0 41
	100.0 82



HE FEI KE JING MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD 合肥科晶材料技术有限公司 www.kjmti.com

KJ GROUP HF-Kejing	自加作曲初种汉水有限公司 www.kjiitti.com
	• 精确度: ±0.5% F.S
	• 流量: 0-10ml/min 可调
	• 最小流量: 0.1ml/min
	• 设备背面其中一个 ϕ 6. 35 的卡套接头为进液口,将吸液管放置在盛有
	溶液的容器中,蠕动泵可自动抽取液体。
	• 气体流速通过浮子流量计控制,流量计量程: 50-500m1/min
	• 安装了一个压力表,可以观察气液混合罐中的气体压强,压力表量程:
气体流量控制	-0.1-0.15MPa
	• 一个不锈钢针阀控制进气的通断,设备背面其中一个 \(\phi \) 6.35 的卡套接
	• 系统中含有两个加热部分,流体和气体会在一个316不锈钢罐中加热,
	最高温度达到 550 度,此罐已经安装在壳体中,此温度由温控仪表 1 控制,
	测温热偶为 K 型
	• 从混气罐到出气口之间的蒸汽输出管道为不锈钢材质的钢管,加热管
	最高温度能达到 200 度,此温度由温控仪表 2 控制,测温传感器为 PT100
	次内皿次間で対し、クロ皿次面皿主人では「主味」、内皿では、間グリードで
加热系统	加热管
AHWAN-AL	蒸汽出气口
	· 温控仪表中带有过热和断偶保护
	• 控温精度: ±10℃
设备外型尺寸	340mm (L) *350mm (W) *600mm (H)
以留外至八寸	340mm (L) *330mm (W) *000mm (H)
	600mm(II
	2000年世
	taggg 340mm
重量	约18KG
质保	一年质保期,终身维护(不包含密封圈等易损耗件)
	• 设备使用时,应先加热。在一次加热管与二次加热管温度达到要求时
	再打开蠕动泵通入液体
	• 在实际使用过程中,根据所需调节流量的大小,过大的流量需要匹配
注意事项	更大的进气量,且如果气压过大,水流量过小也无法产生均匀气体,反之
	进水量过大,气压过小,可能会伴有水滴产生,影响实际使用效果。
	• 连接出气口与需连接的设备时,应注意连接管越短越好,在尽可能的
	前提下,缩短连接管的长度,过长的连接管可能会导致冷凝的现象,影响
	实际使用效果。
-	